(19) 日本国特許庁 (JP)

(12)特許公 報 (B2) (11)特許番号

第2500649号

(45)発行日 平成8年(1998)5月29日

(24)登録日 平成8年(1998)3月13日

(51) Int.CL4

裁別記号 庁内整理番号 P I

技術表示箇所

G01N 21/88

GOIN 21/88

J

Z

前求項の数1(全 5 頁)

(21)出蘇路号 特顧平5-275334

(22)出顧日

平成5年(1993)11月4日

(65)公園番号

特買平7-128249

(43)公園日

平成7年(1995) 5月19日

(73)特許権者 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

長尾 政彦 (72)発明者

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気

株式会社内

(74)代理人 **弗理士 京本 首樹 (外2名)**

白石 光男 容查官

(56)参考文献 特別 平5-109848 (JP, A)

特胸 平5-290959 (JP, A)

(54) 【発明の名称】 J C 異物検査装置

(57)【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 検査対象 [Cのリード部分を撮像しアナ ログ画像データを出力するカメラと、前記アナログ画像 データを入力しAD変換を行い濃液画像データを出力す るAD変換回路と、前記濃淡画像データを入力し濃度の 変化点が強調されるように微分処理を行い微分画像デー タを出力する微分回路と、複数のリードを含む検査対象 領域を記憶させておく検査領域記憶回路と、前記検査対 象領域内の微分画像データをあらかじめ設定した第一の 二値化レベルにより二値化画像データに変換し出力する 10 第一の二値化回路と、前記リードの長手方向と平行な方 向の前記二値化画像データの1の数を計測する投影回路 と、前記投影結果をあらかじめ設定した第二の二値化レ ベルで二値化を行い投影二値化データを出力する第二の 二値化回路と、前記投影二値化データのひと1の全ての

連続数をカウントしあらかじめ設定した()と1の連続数 のそれぞれの上限値と下限値の範囲外の連続数が一つで もあれば異物付着と判定する判定回路とを備えることを 特徴とするIC異物検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、異物検査装置に関し、 特に【Cのリード間に付着したモールドかすや機能くず 等の異物を検出するIC異物検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の検査装置は、例えば特別昭61-66908公報に示す「ICリード検出方法」がある。 【0003】との従来の検査装置について図面を参照し て説明する。図3は従来例の検査装置の構成図である。 【()()()4】この従来例の後査装置は、検査対象部品の 画像を入力する撮像素子31と、撮像索子31から入力 した画像を記憶するフレームメモリ32と、フレームメ モリ32からの画像データから演算処理を行い! Cリジ ェクト信号を出力する演算処理部33とを含んで構成さ れる。次に、従来の検査装置について特開昭61-66 908のうち、異物付着後出について図3を参照して説 明する。撮像素子31から入力した画像は、フレームメ モリ32に記憶される。フレームメモリ32から出力さ れる画像データは、演算処理部33に入力される。演算 処理部33では、適当な二値化レベルにより二値化処理 10 された後、リード上の領域にリードの長手方向に二値化 データが "1" → "()" → ^1 ~ と変化した場合は、異 物付着と判定し、欠陥信号を発生する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の検査装 置のリード上に付着した異物付着の検出方法において は、リードに付着した繊維くず等の透過率の高い異物 は、リード部と異物部の濃淡値の差が少なく、濃淡値の 二値化データでは、異物部分のみ"0"にすることは困 難であり、異物の検出ができないという欠点があった。 【()()()(6)また、上述した従来の検査方法による検査 装置では、リード間に付着した異物を検出することはで きないという欠点があった。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のIC異物検査装 置は 検査対象ICのリード部分を撮像しアナログ画像 データを出力するカメラと、アナログ画像データを入力 UAD変換を行い濃淡画像データを出力するAD変換回 路と、濃淡画像ダータを入力し濃度の変化点が強調され るように微分処理を行い微分画像データを出力する微分 回路と、複数のリードを含む検査対象領域を記憶させて おく検査領域記憶回路と、検査対象領域内の微分画像デ ータをあらかじめ設定した第一の二値化レベルにより二 値化画像データに変換し出力する第一の二値化回路と、 リードの長手方向と平行な方向の二値化画像データの1 の数を計測する投影回路と、投影結果をあらかじめ設定 した第二の二値化レベルで二値化を行い投影二値化デー タを出力する第二の二値化回路と、投影二値化データの **①と1の全ての連続数をカウントしあらかじめ設定した** ()と1の連続数のそれぞれの上限値と下限値の範囲外の 40 連続数が一つでもあれば異物付着と判定する判定回路と を含むことを特徴としている。

[0008]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し て説明する。

【①①①9】図1は本発明による | C異物検査装置の一 実施例を示すプロック図である。

【①①】①】との実施例の【〇異物検査装置において、 カメラ1は、検査対象IC2のリード部分を撮像しアナ

ログ画像データaを入力しAD変換を行い滤液画像デー タ D を出力する。尚、A D 変換された濃淡画像データ D を一旦メモリ回路に記憶させた後、メモリ回路から記憶 データの読出しを行い後の処理回路へデータを流す構成 も考えられる。微分回路4は、濃淡画像データ8を入力 し濃度の変化点が強調されるように微分処理を行い微分 画像データでを出力する。検査領域記憶回路5は、複数 のリードを含む検査対象領域を記憶させておき検査対象 領域信号 d を出力する。第一の二値化回路 6 は、検査対 象領域信号はによる領域内の微分画像データでをあらか じめ設定した第一の二値化レベルにより二値化画像デー タeに変換し出力する。投影回路7は、リードの長手方 向と平行な方向の二値化画像データの"1"の数を計測 し計測データイを出力する。第二の二値化回路8は、計 測データイを入力し計測データをあらかじめ設定した第 二の二値化レベルで二値化を行い投影二値化データッを 出力する。判定回路9は、投影二値化データ8の「0" と"1"の全ての連続数をカウントし、あらかじめ設定 した"()"と"]"の連続数のそれぞれの上限値と下限 値の範囲外の連続数が一つでもあれば、異物付着と判定 する。

【0011】次に、本発明のIC異物検査装置の原理に ついて図1、図2を参照して説明する。

【0012】図2は本発明の10異物検査装置の異物検 出の原理を説明するためのパターン図である。

【りり13】図2(a)は、異物22と異物23がリー ド21に付着している濾液画像データbのパターン図 で、異物22はリード21間の片方のリード21に付着 し、異物23はリード21間にまたがって付着してい る。図2(り)は、二値化画像信号eのパターン図で、 斜線部が二値化後の"1"の領域である。異物22と異 物23のエッジ部分が微分回路4で強調されるので、第 一の二値化回路6により、異物22と異物23のエッジ 部分22′,23′は"1″の領域となる。仮に濃淡画 像データりのままで二値化処理を行うと、反射率の低い 異物部分や透過率の高い異物部分は、濃淡画像データリ のデジタル値が小さいために、図2(e)に示すよう に、異物部分が「1"の領域にならないために異物の検 出は困難である。 図2(c)は、投影回路7から出力 される計測データ子のグラフであり、機輔は図2(b) と位置的に対応している。縦軸は計測度数を示してお り、異物22と異物23のエッジに钼当する領域22! と領域23 "には、異物の付着していないリード21間 より大きい値が存在している。異物が付着していない場 台は、リード21間に対応する計測データ 『の値は *() ** または **() * に近い値となる。従って、第2の二

値化回路には異物の付着していないリード21間の計測 データよりも少し大きい値を設定しておくと、第二の二 値化回路8から出力される投影二億化データでの異物付 ログ画像データaを出力する。AD変換回路3は、アナ 50 若部分は $^{\circ}1$ となる。図2(d)は、投影二値化デー

タ8のグラフを表しており、投影二値化データの"1"の連続数日1、日2、日3、"0"の連続数日1、日2、のうち、異物の付着していない、リード21部分に相当する日1の長さに対して異物の付着しているリード21部分に相当する日2の長さに対して異物の付着している男物の大きさに対応して長くなる。また、リード21間の長さに相当するし1は短くなる。従って、判定回路9では、投影二値化データの"1"と"0"の全ての連続数をカウントし、あらかじめ設定した"0"と"1"の連続数のそれぞれの上限値と下限値の範囲外の連続数があれば、異物付着と判定することができる。

[0014]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の【C異物検査装置では、 歳淡画像を微分処理したあと二値化を行い、 異物領域のエッジを検出して異物検出を行うことにより、 透過率の高い異物やリード間に付着した反射率の低い異物でも確実に検出することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による | C異物検査装置の一実施例を示すプロック図である。

[図2] 本発明の | C異物検査装置の異物検出の原理を 説明するためのパターン図である。図2(a).

(b), (e) は本発明の原理を説明するためのパターン図である。図2(c)、(d) は本発明の原理を説明するためのグラフである。

*【図3】従来例の検査装置の構成図である。 【符号の説明】

1 カメラ

2 IC

3 A D交换回路

4 微分回路

5 検査領域記憶回路

6 第一の二値化回路

7 投影回路

10 8 第二の二値化回路

9 判定回路

21 リード

22.23 異物

22', 23' エッジ部分

221,231 領域

31 撮像素子

32 フレームメモリ

33 演算処理部

H1、H2, H3, L1、L2 連続数

20 a アナログ画像データ

b 濃淡画像データ

c 微分画像データ

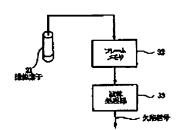
d 検査対象領域信号

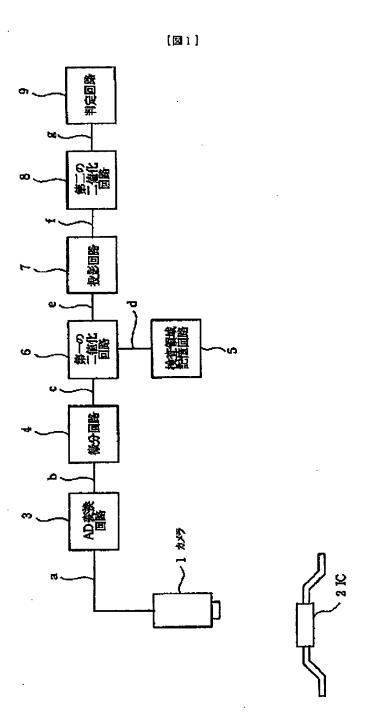
e 二値化画像データ

計測データ

g 投影二倍化データ

[図3]





特許2500649

